

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 1 区分

【発行日】平成 17 年 6 月 9 日 (2005.6.9)

【公開番号】特開 2003-275653 (P2003-275653A)

【公開日】平成 15 年 9 月 30 日 (2003.9.30)

【出願番号】特願 2002-81290 (P2002-81290)

【国際特許分類第 7 版】

B 0 5 C 7/04

B 0 5 C 9/14

B 0 5 C 11/10

B 0 5 C 13/02

B 0 5 D 3/00

B 0 5 D 3/02

B 0 5 D 7/22

H 0 1 J 9/22

【F I】

B 0 5 C 7/04

B 0 5 C 9/14

B 0 5 C 11/10

B 0 5 C 13/02

B 0 5 D 3/00 C

B 0 5 D 3/02 Z

B 0 5 D 7/22 F

B 0 5 D 7/22 T

H 0 1 J 9/22 D

H 0 1 J 9/22 F

【手続補正書】

【提出日】平成 16 年 8 月 31 日 (2004.8.31)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 4 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 4 6】

したがって、第 1 ヒーター 2 の温度を低くすることで、薄い膜厚の塗膜 5 a を形成することができ (図 4 (a) 参照)、第 1 ヒーター 2 の温度を高くすることで、厚い膜厚の塗膜 5 b を形成することができる (図 4 (b) 参照)。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 5 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 5 5】

図 7 は塗膜の厚さに分布を持たせるとともに細管を冷却することで液溜りの位置を制御する例を示す説明図である。

本例においては、図 5 に示した方法を適用し、細管 1 の円周方向における厚さを変えて、細管 1 の内面に、薄い膜厚の塗膜 5 a と厚い膜厚の塗膜 5 b を形成する。そして、同時に、細管 1 を冷却装置 8 で冷却することで、液溜りの位置を制御する。冷却装置 8 を配置

する位置は、図 6 (a) ~ 図 6 (c) で示した例と同じである。